

## 「サンエースMC」開発における生産技術

滝沢 寿 ほか

Hisashi Takizawa and others

### 1. まえがき

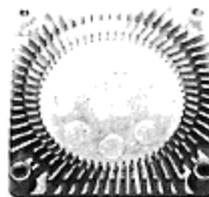
近年、コンピュータの高速化、高機能化への移り変わりはめざましいものがある。なかでもコンピュータの中核デバイスであるマイクロプロセッサ(MPU)の集積度の向上は著しいが、それにともないMPUの発熱も増加するため、小型高性能な冷却装置が必要となる。そこで開発されたのが、「サンエースMC」で、MPUに直接搭載し冷却する冷却装置である。

本稿では、この「サンエースMC」の開発・設計段階において反映した生産技術として、(1)薄肉ヒートシンクのダイカスト工法確立、(2)接着をなくしたステータとフレームの固定構造、および(3)自動はんだ付けを可能とした端子形状について紹介する。

\* 以下に見出しのみを列挙します。

### 2. 薄肉ヒートシンクのダイカスト工法確立

- 2.1 取組の背景
- 2.2 ヒートシンク製造工法の選定
- 2.3 ダイカスト工法の立ち上げ
- 2.4 技術応用



ダイカスト完成品  
(本文中 図3より)

### 3. 接着をなくしたステータとフレームの固定構造

- 3.1 開発の背景
- 3.2 これまでの固定方法
- 3.3 新工法
- 3.4 開発による効果

### 4. 自動はんだ付けを可能とした端子形状

- 4.1 開発の背景
- 4.2 端子形状の条件
- 4.3 工法の確立
- 4.4 自動化による効果

### 5. むすび

SANYO DENKI

Technical Report No.2

Nov. 1996